

Integrierter Nahtloser Polytetrafluoroethylen- Laborreinigungswaschtisch Aus Ptfe In Hoher Reinheit Mit Überlauftank

Artikelnummer: PL-CP32



Einführung

Ingenieurtechnisch gefertigte Überlauftanks aus PTFE in hoher Reinheit mit integrierter nahtloser Konstruktion für aggressives chemisches Beizen. Diese langlebigen schweißfreien Waschtische gewährleisten Nullleckage und überlegene chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in der Halbleiter- und Industriallaboratoriumstechnik.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiterwafer-Ätzung	Säurebäder in hoher Reinheit zum Entfernen von Dünnschichten und Oxidschichten von Siliziumwafern.	Keine Spurenmetallkontamination und präzise Kontrolle der Badkonzentration.
Texturierung von Solarzellen	Großmaßstäbliche chemische Behandlung von solargradem Silizium zur Verbesserung der Lichtabsorptionseigenschaften.	Chemische Beständigkeit gegen aggressive Texturierungsmittel und langfristige Haltbarkeit.
Präzisionsmetallbeizung	Entfernung von Oberflächenverunreinigungen und Zunder aus Luft- und Raumfahrt- sowie medizinischen Speziallegierungen.	Beständigkeit gegen konzentrierte Säuregemische ohne strukturellen Abbau.
Vorbereitung der Spurenanalyse	Reinigung von Laborgerät aus Glas und Sensoren in einer Durchflussumgebung mit Säure in hoher Reinheit.	Ultra-niedriger Hintergrundrauschen und Verhinderung der Adsorption von Analyten.
Pharmazeutische Reinigung	Sterilisation und Reinigung von Komponenten in hoher Reinheit unter Verwendung aggressiver Desinfektionsmittel.	Glatte, nicht poröse Oberflächen verhindern Bakterienwachstum und chemische Rückstände.
Batterieforschung	Testen von Elektrodenmaterialien in korrosiven Elektrolyten für die Entwicklung von Lithium-Ionen- und Durchflussbatterien.	Vollständige chemische Isolation und Verhinderung von elektrolytbedingten Leckagen.
Galvanikbäder	Bereitstellung eines stabilen, nicht reaktiven Gefäßes für spezielle Galvanikprozesse mit Gold oder Platin.	Beseitigung elektrochemischer Interferenzen durch Tankmaterialien.
Chemikalienlagerung	Langzeitcontainment von ultrareinen Reagenzien, die keinen Kontakt mit metallischen oder Glasoberflächen erfordern.	Erhaltung der Reagenzienqualität über längere Lagerperioden.

Funktion	Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP32)
Basismaterial	100 % neues PTFE (Polytetrafluorethylen) in hoher Reinheit
Fertigungsmethode	Integrierte einteilige CNC-Bearbeitung (nahtlos/schweißfrei)
Betriebstemperaturbereich	-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)
Chemische Beständigkeit	Universelle Beständigkeit (außer geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor)
Designart	Integriertes Überlaufsystem (intern/extern)
Wandstärke	Standard 10 mm bis 30 mm (vollständig anpassbar)
Oberflächenfinish	Hochpräzises glattes Finish (Ra < 0,8 µm verfügbar)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Funktion	Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP32)	
Abmessungskapazität	Maßgefertigt von kleinen Labormaßstäben bis zu großen industriellen Volumina	
Portkonfigurationen	Optionale PFA/PTFE-Gewindeanschlüsse, Flansche oder Überlaufwehre	
Zertifizierung	Materialsicherheit und Reinheitskonformität für den Einsatz in Reinräumen	
Anpassungsoptionen	Abmessungen, Wandstärke, Deckeldesign, interne Leitbleche und Sensorhalterungen	